РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В ТВЕРДОМ ТЕЛЕ И ПЛАЗМЕ

УДК 533.9

К ТЕОРИИ ЕМКОСТНОГО РАЗРЯДА В ПОПЕРЕЧНОМ ВНЕШНЕМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

© 2023 г. И. Н. Карташов^{а, *}, М. В. Кузелев^а

^а Физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Ленинские горы, 1, стр. 2, Москва, 119991 Российская Федерация

> **E-mail: igorkartashov@mail.ru* Поступила в редакцию 13.02.2023 г. После доработки 13.02.2023 г. Принята к публикации 03.03.2023 г.

Рассмотрены электродинамические свойства плазмы высокочастотного емкостного разряда с магнитным полем вдоль пластин конденсатора. Вычислен комплексный импеданс такой системы. На основе эквивалентной электротехнической схемы плазменного конденсатора проанализированы резонансные свойства разряда. Продемонстрирована роль ионов в устойчивости дрейфующего в скрещенных электрическом и магнитном полях потока электронов.

DOI: 10.31857/S0033849423120094, EDN: HVCWTQ

ВВЕДЕНИЕ

Внешнее магнитное поле, перпендикулярное разрядному току, существенно влияет на электромагнитные свойства высокочастотного емкостного (ВЧЕ) разряда, что обусловлено в первую очередь затрудненностью поляризации плазмы поперек магнитного поля. В определенном диапазоне частот продольное электрическое поле слабо экранируется магнитоактивной плазмой в направлении, перпендикулярном внешнему магнитному полю, что наводит на мысль о возможном улучшении некоторых параметров ВЧЕ-разряда применением внешнего магнитного поля. Следует заметить, что в разрядах постоянного тока использование внешнего магнитного поля перпендикулярного разрядному току давно показало свою эффективность (даже необходимость) в стационарных плазменных двигателях (СПД) [1]. В этих двигателях существенной оказывается еще одна роль внешнего магнитного поля: поперечный дрейф замагниченных электронов плазмы в скрещенных постоянных внешнем магнитном и разрядном электрическом полях. Незамагниченные же ионы плазмы свободно ускоряются электрическим полем разряда, создавая тем самым тягу СПД [1].

В связи с задачей разработки низкоорбитальных космических аппаратов возникла идея замены рабочего газа СПД, а именно, инертный газ заменить на атмосферный воздух. Для преодоления возникших в связи с такой заменой трудностей было предложено вместо разряда постоянного тока на базе стандартной конструкции СПД организовать ВЧЕ-разряд. Параметры холловских двигателей на ВЧЕ-разряде с поперечным магнитным полем исследованы в работе [2].

В данной работе не ставится задача расчета плазменного двигателя на ВЧЕ-разряде с поперечным магнитным полем. В реальной геометрии плазменного двигателя получить какие-либо аналитические результаты вряд ли возможно. Однако основной элемент плазменного двигателя - сам ВЧЕ-разряд в поперечном магнитном поле – в простейшей геометрии исследовать не сложно, чему и посвящена эта работа. Мы совсем не обсуждаем здесь вопросов создания и поддержания плазмы разряда, полностью действуя в духе работ [3, 4]. Фактически речь пойдет об электромагнитных, точнее электротехнических, свойствах плазменного конденсатора простейшей геометрии, помещенного в однородное внешнее магнитное поле.

1. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ ПЛАЗМЕННОГО КОНДЕНСАТОРА

Рассмотрим плоский плазменный конденсатор, помещенный в однородное внешнее магнитное поле, параллельное плоскостям обкладок конденсатора x = 0 и x = d. Пусть внешнее магнитное поле $\vec{B}_0 = \{0, 0, B_0\}$ направлено вдоль координатной оси *z*. Считая плазму холодной и пренебрегая движением тяжелых ионов, запишем следующую систему уравнений для скалярного потенциала электрического поля $\varphi(t, x, y, z)$, гидродинамической плотности N(t, x, y, z) и компонент гидродинамической скорости $V_{x,y,z}(t, x, y, z)$ электронов плазмы:

$$\frac{\partial^{2} \varphi}{\partial x^{2}} + \frac{\partial^{2} \varphi}{\partial y^{2}} + \frac{\partial^{2} \varphi}{\partial z^{2}} = -4\pi e(N - n_{0e}),$$

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(NV_{x}) + \frac{\partial}{\partial y}(NV_{y}) + \frac{\partial}{\partial z}(NV_{z}) = 0,$$

$$\frac{\partial V_{x}}{\partial t} + V_{x}\frac{\partial V_{x}}{\partial x} + V_{y}\frac{\partial V_{x}}{\partial y} + V_{z}\frac{\partial V_{x}}{\partial z} =$$

$$= \Omega_{e}V_{y} - \frac{e}{m}\frac{\partial \varphi}{\partial x} - v_{e}V_{x},$$
(1)
$$\frac{\partial V_{y}}{\partial t} + V_{x}\frac{\partial V_{y}}{\partial x} + V_{y}\frac{\partial V_{y}}{\partial y} + V_{z}\frac{\partial V_{y}}{\partial z} =$$

$$= -\Omega_{e}V_{x} - \frac{e}{m}\frac{\partial \varphi}{\partial y} - v_{e}V_{y},$$

$$\frac{\partial V_{z}}{\partial t} + V_{x}\frac{\partial V_{z}}{\partial x} + V_{y}\frac{\partial V_{z}}{\partial y} + V_{z}\frac{\partial V_{z}}{\partial z} = -\frac{e}{m}\frac{\partial \varphi}{\partial z} - v_{e}V_{z},$$

где $\Omega_e = eB_0/mc$ — электронная циклотронная частота, v_e — эффективная частота столкновений электронов (с нейтральными атомами и ионами), n_{0e} — невозмущенная плотность электронов плазмы. Пока считаем, что плотность плазмы в конденсаторе не зависит от координат. Полагая, что одна из обкладок конденсатора заземлена, а другая подсоединена к внешнему источнику синусоидального напряжения частоты ω , для скалярного потенциала запишем следующие граничные условия:

$$\varphi(t, 0, y, z) = 0,$$

$$\varphi(t, d, y, z) = -\operatorname{Re}[U_0 \exp(-i\omega t)].$$
(2)

Если расстояние между обкладками конденсатора мало по сравнению с их поперечным размером, то можно пренебречь краевыми эффектами (т.е. принять $\partial/\partial y = \partial/\partial z = 0$) и записать систему (1) в виде

$$\frac{\partial^{2} \varphi}{\partial x^{2}} = -4\pi e(N - n_{0e}),$$

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(NV_{x}) = 0,$$

$$\frac{\partial V_{x}}{\partial t} + V_{x}\frac{\partial V_{x}}{\partial x} = \Omega_{e}V_{y} - \frac{e}{m}\frac{\partial \varphi}{\partial x} - v_{e}V_{x},$$

$$\frac{\partial V_{y}}{\partial t} + V_{x}\frac{\partial V_{y}}{\partial x} = -\Omega_{e}V_{x} - v_{e}V_{y},$$

$$\frac{\partial V_{z}}{\partial t} + V_{x}\frac{\partial V_{z}}{\partial x} = -v_{e}V_{z}.$$
(3)

Решение системы уравнений (3) возьмем следующее:

$$\begin{split} \varphi_0(t,x) &= -E_0 x \exp(-i\omega t), \\ N(t,x,y,z) &= n_{0e}, \\ V_z(t,x,y,z) &= 0, \\ V_x(t,x,y,z) &= i \frac{e}{m} E_0 \exp(-i\omega t) \times \\ \times \frac{(\omega + iv_e)}{(\omega + iv_e)^2 - \Omega_e^2} \equiv V_{0x}(t), \\ V_y(t,x,y,z) &= \frac{e}{m} E_0 \exp(-i\omega t) \times \\ \times \frac{\Omega_e}{(\omega + iv_e)^2 - \Omega_e^2} \equiv V_{0y}(t), \end{split}$$

где $E_0 = U_0/d$, а комплексная амплитуда U_0 определена в (2). Отметим, что поскольку для решений (4) нелинейные члены в уравнениях (3) равны нулю, мы записали эти решения в комплексной форме, не выделяя вещественную часть. Вообще говоря, решение (4) не является единственным ввиду наличия производных по *x* в системе (3) и возможности постановки различных граничных условий для скорости. Если амплитуда колебаний частиц во внешнем электрическом поле и радиус ларморовского вращения малы по сравнению с *d*, то зависимостью от координаты *x* в гидродинамической скорости также можно пренебречь и считать систему квазиоднородной, что и было сделано.

2. ИМПЕДАНС ПЛАЗМЕННОГО КОНДЕНСАТОРА

Наличие скорости $V_{0x}(t)$ приводит к появлению дополнительных поляризационных зарядов на обкладках конденсатора. Плотность поляризационного тока определяется формулой

$$j_{p}(t) = \frac{\partial P_{x}}{\partial t} = en_{0e}V_{0x}(t) =$$

$$= i\frac{\omega_{Le}^{2}}{4\pi}E_{0}\exp(-i\omega t)\frac{(\omega+iv_{e})}{(\omega+iv_{e})^{2}-\Omega_{e}^{2}},$$
(5)

где ω_{Le} — ленгмюровская частота электронов плазмы, а P_x — компонента вектора поляризации. Из (5) и формулы $\vec{D} = \vec{E} + 4\pi \vec{P}$ находим выражение для нормальной к обкладкам конденсатора компоненты вектора индукции электрического поля

$$D_x = \varepsilon_{\perp}(\omega) E_0 \exp(-i\omega t), \qquad (6)$$

где

$$\varepsilon_{\perp}(\omega) = 1 - \frac{\omega_{Le}^{2}(\omega + i\nu_{e})}{\omega[(\omega + i\nu_{e})^{2} - \Omega_{e}^{2}]}.$$
(7)

РАДИОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА том 68 № 12 2023

Используя далее граничное условие на обкладке конденсатора

$$D_x(x=0)=4\pi\sigma_0$$

(σ₀ – поверхностная плотность электрического заряда), получаем следующее соотношение:

$$q_0 = \varepsilon_\perp \frac{S}{4\pi d} U_0, \tag{8}$$

где *S* – площадь обкладки конденсатора, q_0 – комплексная амплитуда электрического заряда на обкладке (с учетом временной зависимости, как это следует из (2), заряд обкладки конденсатора равен Re[$q_0 \exp(-i\omega t)$]). При получении (8) считалось, что $\sigma_0 = q_0/S$, что согласуется с предположением об отсутствии в конденсаторе краевых эффектов.

По определению емкостью конденсатора называется коэффициент пропорциональности между зарядом на обкладке и разностью потенциалов между обкладками. Таким образом, для емкости плазменного конденсатора имеем

$$C_p = \varepsilon_{\perp} C_0, \tag{9}$$

где $C_0 = S/(4\pi d)$ — емкость соответствующего вакуумного конденсатора.

Известно, что структура тензора диэлектрической проницаемости холодной однородной магнитоактивной плазмы определяется формулой [5, 6]

$$\varepsilon_{ij}(\omega) = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx}(\omega) & \varepsilon_{xy}(\omega) & 0\\ \varepsilon_{yx}(\omega) & \varepsilon_{yy}(\omega) & 0\\ 0 & 0 & \varepsilon_{zz}(\omega) \end{pmatrix}.$$
 (10)

Здесь *i*, *j* = *x*, *y*, *z*, а $\varepsilon_{xx} = \varepsilon_{yy} = \varepsilon_{\perp}$, где ε_{\perp} совпадает с величиной (7). Также известно, что емкость конденсатора с однородным изотропным диэлектрическим заполнением отличается от емкости соответствующего вакуумного конденсатора множителем ε_0 , где ε_0 – диэлектрическая проницаемость заполнения [7]. Формула (9) показывает, что аналогичный результат имеет место и в случае конденсатора, заполненного анизотропной магнитоактивной плазмой.

Предположим теперь, что рассматриваемый плазменный конденсатор включен в электрическую цепь, по которой протекает ток на частоте ω и с комплексной амплитудой I_0 . Поскольку амплитуды тока в цепи и поверхностного заряда на обкладке конденсатора связаны соотношением $I_0 = -i\omega q_0$, то формулу (8) можно записать в форме закона Ома для участка цепи $U_0 = I_0 Z_p$, где

$$Z_p = \frac{i}{\omega C_p} = \frac{i}{C_0} \frac{\left(\omega + iv_e\right)^2 - \Omega_e^2}{\omega \left[\left(\omega + iv_e\right)^2 - \Omega_e^2\right] - \omega_{Le}^2(\omega + iv_e)} (11)$$

 импеданс плазменного конденсатора. В бесстолкновительном пределе формула для импеданса принимает вид



Рис. 1. Импеданс плазменного конденсатора: $\operatorname{Re} Z_p$ (сплошная кривая), $\operatorname{Im} Z_p$ (штриховая кривая).

$$Z_p = \frac{i}{\omega C_p} = \frac{i}{\omega C_0} \frac{\omega^2 - \Omega_e^2}{\omega^2 - \Omega_g^2},$$
 (12)

где $\Omega_g = \sqrt{\Omega_e^2 + \omega_{Le}^2}$ — верхняя гибридная частота.

Формулы (11) и (12) несложно обобщить на случай, когда плазма заполняет конденсатор не полностью. Пусть однородный слой плазмы отделен от обкладок конденсатора одинаковыми слоями изотропного диэлектрика с проницаемостью ε_0 , поэтому

$$\omega_{Le}^{2}(x) = \begin{cases} 0, \ 0 < x < \Delta, \\ \omega_{Le}^{2} = \text{const}, \ \Delta \le x \le d - \Delta, \\ 0, \ d - \Delta < x < d. \end{cases}$$
(13)

Очевидно, что если на границах слоя плазмы поместить бесконечно тонкие проводящие плоскости, то емкость конденсатора не изменится, но плазменный конденсатор с диэлектрическими слоями превратится в последовательное соединение двух диэлектрических конденсаторов и одного конденсатора с однородным плазменным заполнением. Так как при последовательном соединении импедансы складываются, то для импеданса плазменного конденсатора с диэлектрическими слоями имеем

 $Z_p = 2\frac{i}{\omega C_{\Delta}} + \frac{i}{\omega \varepsilon_{\perp}},$

где

$$C_{\Delta} = \frac{\varepsilon_0 S}{4\pi\Delta}, \quad C'_0 = \frac{S}{4\pi(d-2\Delta)}.$$
 (15)

(14)

На рис. 1 изображен импеданс плазменного конденсатора со следующими параметрами: $v_e/\omega_{Le} = 0.05$, $\Omega_e/\omega_{Le} = 0.5$, $\Delta/d = 0.3$, $\varepsilon_0 = 1$.



Рис. 2. Эквивалентная схема плазменного конденсатора.

3. ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА ПЛАЗМЕННОГО КОНДЕНСАТОРА. РЕЗОНАНСЫ

Рассмотрим схему, изображенную на рис. 2, где C, C_1 и Λ обычные (не плазменные) емкости и индуктивность.

Комплексный импеданс для изображенной схемы определяется формулой

$$Z_0 = \frac{i}{\omega C_{\Sigma}} \frac{\omega^2 - \beta \omega_0^2}{\omega^2 - \omega_0^2},$$
 (16)

где $C_{\Sigma} = C_1 C / (C_1 + C)$, $\beta = C / (C_1 + C)$, а $\omega_0 = 1 / \sqrt{\Lambda C}$. Сравнивая формулы (16) и (12), видим их полную тождественность, если положить

$$\begin{aligned} C_{\Sigma} &= C_0 \\ \omega_0^2 &= \Omega_g^2 \\ \beta \omega_0^2 &= \Omega_e^2 \end{aligned} \} &\rightarrow \begin{cases} C &= C_0 \,\Omega_g^2 \big/ \omega_{Le}^2 \\ C_1 &= C_0 \,\Omega_g^2 \big/ \Omega_e^2 \\ \Lambda &= (\Omega_g^2 C_0)^{-1} \,\omega_{Le}^2 \big/ \Omega_g^2 \end{aligned} .$$
(17)

Таким образом, эквивалентной схемой однородного плазменного конденсатора в поперечном внешнем магнитном поле является схема, представленная на рис. 2. Параметры эквивалентной схемы однозначно определяются формулами (17). В случае плазменного конденсатора с диэлектрическими прослойками, формулы (17) по-прежнему имеют место, только в эквивалентной схеме последовательно с конденсатором C_1 следует подключить две емкости C_{Λ} .

Формулы (17) и электрическая схема на рис. 2 применимы, если столкновениями в плазме можно пренебречь. Эквивалентную схему плазменного конденсатора со столкновениями можно сконструировать включением дополнительных активных сопротивлений, в первую очередь активного сопротивления последовательного индуктивности Λ . Мы не будем приводить здесь соответствующие схемы и формулы, поскольку в разных частотных диапазонах они оказываются неодинаковыми, в отличие от "бесстолкновительной" схемы рис. 2, справедливой при любой частоте ω .

Импеданс (12) и эквивалентный импеданс (16) имеют ноль и полюс. В случае импеданса (16) ноль соответствует резонансу напряжений, а по-

люс — резонансу токов в схеме, представленной на рис. 2. Следовательно, такие же резонансы имеют место и в плазменном конденсаторе в поперечном внешнем магнитном поле. Резонанс напряжений имеет место при

$$\omega = \Omega_{\rho}, \tag{18}$$

а резонанс токов – при

$$\omega = \sqrt{\omega_{Le}^2 + \Omega_e^2}.$$
 (19)

При $v_e = 0$ в точке

$$\omega = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 \Omega_e^2 + 2[\omega_{Le}^2 - (\varepsilon_0 - 1)\Omega_e^2]\Delta/d}{\varepsilon_0 - 2(\varepsilon_0 - 1)\Delta/d}}$$
(20)

обращается в ноль и импеданс (14). Последняя формула дает условие резонанса напряжений в конденсаторе с диэлектрическими зазорами, а условие резонанса токов по-прежнему дается формулой (19). При $\varepsilon_0 = 1$ и $\Omega_e = 0$ выражение (20) переходит в известное условие геометрического резонанса $\omega = \omega_{Le} \sqrt{2\Delta/d}$ [8].

На рис. 1 резонансу (19) соответствует точка, в которой вещественная часть импеданса достигает максимального значения, а резонансу (20) соответствует точка, в которой обращается в ноль мнимая часть импеданса. Заметим, что формулы (18)–(20) получены для случая бесстолкновительной плазмы, когда $v_e = 0$ и вещественная часть импеданса тождественно равна нулю. Однако при $v_e \ll \omega$ резонансные точки, показанные на рис. 1 и определяемые формулами (19) и (20), с точностью до величин v_e/ω совпадают.

Заметим, что понятие импеданса, так же как и само понятие высокочастотного разряда, имеют смысл только в квазистационарной области частот, которую можно определить неравенством

$$\frac{\omega}{c}d \ll 1. \tag{21}$$

Очевидно, что в соответствии с формулами (18)– (20) о резонансах напряжений и токов в плазменном конденсаторе уместно говорить только в том случае, когда электронная циклотронная частота Ω_e и электронная ленгмюровская частота ω_{Le} сами попадают в квазистационарную область. Например, в случае упомянутых ранее экспериментов [2] частота ω безусловно принадлежит квазистационарному диапазону, а Ω_e и ω_{Le} существенно выше. В этом случае для диэлектрической проницаемости (7) можно записать

$$\varepsilon_{\perp}(\omega) = 1 + \frac{\omega_{Le}^2}{\Omega_e^2} \left(1 + i \frac{\mathbf{v}_e}{\omega} \right).$$
(22)

При этом резонансные свойства конденсатора вообще не проявляются, а его эквивалентная схема

с учетом столкновений сводится к последовательному соединению емкости и активного сопротивления.

4. ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ПЛАЗМЕННОГО КОНДЕНСАТОРА В ПОПЕРЕЧНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Можно сказать, что формулы (4) описывают невозмущенное (равновесное) состояние плазмы и поля в рассматриваемом конденсаторе. Эти формулы являются точным решением нелинейной системы (3), а значит, и полной системы (1), если конечно пренебречь краевыми эффектами. Встает вопрос об устойчивости состояния, описываемого формулами (4). Попытаемся частично ответить, пренебрегая, как и прежде, движением ионов плазмы и считая, что плазма заполняет конденсатор полностью (без диэлектрических зазоров), а также полагая $v_e = 0$.

При наличии возмущений ищем решения уравнений (1) в виде

$$\varphi(t, x, y, z) = \operatorname{Re}[\varphi_0(t, x)] +$$

$$+ \tilde{\varphi}(t, x) \exp(ik_y y + ik_z z),$$

$$V_x(t, x, y, z) = \operatorname{Re}[V_{0x}(t)] +$$

$$+ \tilde{V}_x(t, x) \exp(ik_y y + ik_z z),$$

$$V_y(t, x, y, z) = \operatorname{Re}[V_{0y}(t)] +$$

$$+ \tilde{V}_y(t, x) \exp(ik_y y + ik_z z),$$

$$V_z(t, x, y, z) = \tilde{V}_z(t, x) \exp(ik_y y + ik_z z),$$

$$N(t, x, y, z) = n_{0e} + \tilde{N}(t, x) \exp(ik_y y + ik_z z),$$
(23)

где величины со знаком ~ обозначают малые возмущения. При написании формул (23) мы считали конденсатор безграничным по координатам yи z, что согласуется с исходным предположением об отсутствии краевых эффектов. В линейном по возмущениям приближении из уравнений (1) имеем следующую систему для возмущений:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \tilde{\varphi}}{\partial x^2} &- (k_y^2 + k_z^2) \tilde{\varphi} = -4\pi e \tilde{N}, \\ \frac{\partial \tilde{N}}{\partial t} &+ \left(n_{0e} \frac{\partial \tilde{V}_x}{\partial x} + V_{0x}' \frac{\partial \tilde{N}}{\partial x} \right) + \\ &+ i k_y (n_{0e} \tilde{V}_y + V_{0y}' \tilde{N}) + i k_z n_{0e} \tilde{V}_z = 0, \\ \frac{\partial \tilde{V}_x}{\partial t} &+ V_{0x}' \frac{\partial \tilde{V}_x}{\partial x} + i k_y V_{0y}' \tilde{V}_x = \Omega_e \tilde{V}_y - \frac{e}{m} \frac{\partial \tilde{\varphi}}{\partial x}, \\ \frac{\partial \tilde{V}_y}{\partial t} &+ V_{0x}' \frac{\partial \tilde{V}_y}{\partial x} + i k_y V_{0y}' \tilde{V}_y = -\Omega_e \tilde{V}_x - i k_y \frac{e}{m} \tilde{\varphi}, \\ \frac{\partial \tilde{V}_z}{\partial t} &+ V_{0x}' \frac{\partial \tilde{V}_z}{\partial x} + i k_y V_{0y}' \tilde{V}_z = -i k_z \frac{e}{m} \tilde{\varphi}. \end{aligned}$$
(24)

Здесь штрихом обозначены вещественные части скоростей V_{0x} и V_{0y} . Если рассматривать систему (24)

РАДИОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА том 68 № 12 2023

как краевую задачу по координате x, то ее исследование окажется весьма сложным. Учитывая упоминавшуюся выше квазиоднородность системы, поступим по-другому. Будем рассматривать всю схему, включающую плазменный конденсатор, источник напряжения, подводящие провода и т.п., как "кольцевую" систему, по которой распространяется некоторая волна. В этом случае зависимость возмущений от координаты x можно описать функцией $exp(ik_x x)$. Тогда, исключая из (24) возмущение потенциала, несложно получить следующую систему уравнений:

$$\begin{aligned} \frac{d\tilde{n}}{dt} + i(k_x\tilde{V}_x + k_y\tilde{V}_y + k_z\tilde{V}_z) + iW(t)\tilde{n} &= 0, \\ \frac{d\tilde{V}_x}{dt} + iW(t)\tilde{V}_x &= \Omega_e\tilde{V}_y - \frac{ik_x}{k^2}\omega_{Le}^2\tilde{n}, \\ \frac{d\tilde{V}_y}{dt} + iW(t)\tilde{V}_y &= -\Omega_e\tilde{V}_x - \frac{ik_y}{k^2}\omega_{Le}^2\tilde{n}, \\ \frac{d\tilde{V}_z}{dt} + iW(t)\tilde{V}_z &= -\frac{ik_z}{k^2}\omega_{Le}^2\tilde{n}. \end{aligned}$$
(25)
Здесь $k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2, \, \tilde{n} = \tilde{N}/n_{0e}, \, a$

$$W(t) = k_x V_{0x} + k_y V_{0y} =$$

$$= \frac{e}{m} \frac{\operatorname{Re}\left[(ik_x \omega + k_y \Omega_e) E_0 \exp(-i\omega t)\right]}{\omega^2 - \Omega_e^2}.$$
(26)

Несложно видеть, что заменой

$$\tilde{A}(t) \to \tilde{A}(t) \exp\left(-i\int W(t)dt\right),$$
 (27)

 $(\tilde{A}(t) -$ любое из входящих в систему (25) возмущений) система преобразуется к виду

$$\frac{d\tilde{n}}{dt} + i(k_x\tilde{V}_x + k_y\tilde{V}_y + k_z\tilde{V}_z) = 0,$$

$$\frac{d\tilde{V}_x}{dt} = \Omega_e\tilde{V}_y - \frac{ik_x}{k^2}\omega_{Le}^2\tilde{n},$$

$$\frac{d\tilde{V}_y}{dt} = -\Omega_e\tilde{V}_x - \frac{ik_y}{k^2}\omega_{Le}^2\tilde{n},$$

$$\frac{d\tilde{V}_z}{dt} = -\frac{ik_z}{k^2}\omega_{Le}^2\tilde{n}.$$
(28)

Полагая входящие в (28) возмущения ~ $\exp(-i\tilde{\omega}t)$, стандартным образом получаем следующее дисперсионное уравнение:

$$(k_x^2 + k_y^2) \left(1 - \frac{\omega_{Le}^2}{\tilde{\omega}^2 - \Omega_e^2} \right) + k_z^2 \left(1 - \frac{\omega_{Le}^2}{\tilde{\omega}^2} \right) = 0.$$
(29)

Последнее уравнение описывает так называемые косые ленгмюровские волны [9], но в силу замены (27) это — волны потока электронов с осциллирующей направленной скоростью. Поскольку частоты $\tilde{\omega}$, определяемые уравнением (29), всегда вещественные, то неустойчивость в плазменном

конденсаторе отсутствует. Правда результат этот получен в рамках весьма жестких предположений: неподвижные ионы, полное заполнение конденсатора плазмой, описание зависимости возмущений от координаты x функцией $\exp(ik_x x)$.

В качестве примера рассмотрим, к чему может привести учет движения ионов. При этом ограничимся стационарным случаем $\omega = 0$, имеющим прямое отношения к процессам в СПД. Хотя скорость дрейфа ионов такая же, как и дрейфовая скорость электронов, ионы плазмы можно считать незамагниченными. Дело в том, что дрейфовое движение ионов нивелируется другими движениями, а именно — тепловым движением и движением, обусловленным возмущением самосогласованного электрического поля. Поэтому распределение ионов плазмы по скоростям считаем изотропным.

В этом случае тензор диэлектрической проницаемости плазмы получается прибавлением к диагональным членам тензора диэлектрической проницаемости электронов ионного вклада, равного $-\omega_{Li}^2/\tilde{\omega}^2$, где ω_{Li} — ионная ленгмюровская частота. Электронная диэлектрическая проницаемость получается из уравнений (25), в которых при $\omega = 0$ будет $W(t) = -k_y V_d$, где $V_d = eE_0/m\Omega_e$ — скорость дрейфа. В результате несложных вычислений для поперечной и продольной (поперек и вдоль внешнего магнитного поля) компонент тензора диэлектрической проницаемости электрон-ионной плазмы с анизотропными электронами и изотропными ионами получаются следующие выражения:

$$\varepsilon_{\perp} = 1 - \frac{\omega_{Le}^2}{\left(\tilde{\omega} - k_y V_d\right)^2 - \Omega_e^2} - \frac{\omega_{Li}^2}{\tilde{\omega}^2},$$

$$\varepsilon_{\parallel} = 1 - \frac{\omega_{Le}^2}{\left(\tilde{\omega} - k_y V_d\right)^2} - \frac{\omega_{Li}^2}{\tilde{\omega}^2}.$$
(30)

Как известно, дисперсионное уравнение для определения частот $\tilde{\omega}$ системы с диэлектрическими проницаемостями ε_{\perp} и ε_{\parallel} в потенциальном приближении имеет вид $(k_x^2 + k_y^2)\varepsilon_{\perp} + k_z^2\varepsilon_{\parallel} = 0$ [10]. Откуда, с учетом формул (30), получается следующее дисперсионное уравнение:

$$1 - \frac{\omega_{Li}^{2}}{\tilde{\omega}^{2}} - \frac{k_{x}^{2} + k_{y}^{2}}{k^{2}} \frac{\omega_{Le}^{2}}{(\tilde{\omega} - k_{y}V_{d})^{2} - \Omega_{e}^{2}} - \frac{k_{z}^{2}}{k^{2}} \frac{\omega_{Le}^{2}}{(\tilde{\omega} - k_{y}V_{d})^{2}} = 0,$$
(31)

при решении которого следует считать, что выполнено неравенство $\omega_{Li}^2 \ll \omega_{Le}^2$. Несложно видеть, что дисперсионное уравнение (31) имеет комплексные решения относительно частоты $\tilde{\omega}$, т.е. описывает неустойчивую систему. Рассмотрим два частных случая.

В случае если доминирующей является k_z -компонента, то уравнение (31) перейдет в уравнение

$$1 - \frac{\omega_{Li}^2}{\tilde{\omega}^2} - \frac{\omega_{Le}^2}{\left(\tilde{\omega} - k_v V_d\right)^2} = 0,$$
(32)

по виду совпадающее с уравнением, описывающим известную бунемановскую неустойчивость безграничной плазмы с током [6, 10]. Из (32), предполагая выполненным неравенства $|\tilde{\omega}| \ll |k_y V_d|$, несложно получить следующие приближенные выражения для инкремента неустойчивости:

$$\tilde{\omega} = i\omega_{Li} \frac{|k_{y}V_{d}|}{\sqrt{\omega_{Le}^{2} - |k_{y}V_{d}|^{2}}}, \ |k_{y}V_{d}| < \omega_{Le},$$

$$\tilde{\omega} = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2} \left(\frac{1}{2}\omega_{Li}^{2}\omega_{Le}\right)^{1/3}, \ |k_{y}V_{d}| = \omega_{Le}.$$
(33)

Применительно к плазменному конденсатору с поперечным магнитным полем неустойчивость с инкрементами (33) уместно назвать дрейфовобунемановской неустойчивостью, нерезонансной (первый инкремент (33)) и резонансной (второй инкремент (33)). Величину k_y в (33) можно оценить из того соображения, что длина волны возмущений в конденсаторе должна быть кратна размеру L_y обкладки конденсатора в этом направлении, например, $k_y \sim \pi/L_y$.

Во втором частном случае малых k_z уравнение (31) записывается в виде

$$1 - \frac{\omega_{Li}^2}{\tilde{\omega}^2} - \frac{\omega_{Le}^2}{\left(\tilde{\omega} - k_v V_d\right)^2 - \Omega_e^2} = 0,$$
(34)

откуда для инкрементов получаются следующие выражения:

$$\widetilde{\omega} = i\omega_{Li}\sqrt{\frac{\left|k_{y}V_{d}\right|^{2} - \Omega_{e}^{2}}{\Omega_{g}^{2} - \left|k_{y}V_{d}\right|^{2}}}, \ \Omega_{e} < \left|k_{y}V_{d}\right| < \Omega_{g},$$

$$\widetilde{\omega} = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} \left(\frac{1}{2}\omega_{Li}^{2}\omega_{Le}\frac{\omega_{Le}}{\left|k_{y}V_{d}\right|}\right)^{1/3}, \ \left|k_{y}V_{d}\right| = \Omega_{g}.$$
(35)

Неустойчивость с инкрементом (35) можно классифицировать как дрейфово-циклотронную неустойчивость — нерезонансную (первый инкремент (35)) и резонансную (второй инкремент (35)). Вероятно, что в случае конденсатора с ВЧ-полем, т.е. при $\omega \neq 0$, при учете движения ионов должны появиться еще какие-то неустойчивости, например параметрические, рассмотрению которых мы предполагаем посвятить отдельную работу.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 22-29-00642).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Морозов А.И*. Энциклопедия низкотемпературной плазмы. Т. 3. С. 443. М.: Наука, 2000.
- Shvydkiy G.V., Zadiriev I.I., Kralkina E.A., Vavilin K.V. // Vacuum. 2020. V. 180. P. 109588.
- 3. Александров А.Ф., Кузелев М.В. Теоретическая плазменная электротехника. М.: Изд-во физического факультета МГУ, 2011.
- Александров А.Ф., Кузелев М.В., Рухадзе А.А. // РЭ. 2010. Т. 55. № 7. С. 826.

- 5. Гинзбург В.Л., Рухадзе А.А. Волны в магнитоактивной плазме. М.: Наука, 1970.
- 6. Кузелев М.В. Введение в физику плазмы. М.: Ленанд, 2022.
- 7. *Сивухин Д.В.* Общий курс физики. Электричество. М.: Физматлит, 2004.
- 8. *Савинов В.П.* Физика высокочастотного емкостного разряда. М.: Физикалит, 2013.
- 9. Кузелев М.В., Рухадзе А.А., Стрелков П.С. Плазменная релятивистская СВЧ-электроника. М.: Ленанд, 2018.
- Александров А.Ф., Богданкевич Л.С., Рухадзе А.А. Основы электродинамики плазмы. М.: Высш. шк., 1978.